

# SEMICON Japan 2021 出展のご案内



期間 : 2021年12月15日 (水) ~12月17日 (金) 10:00-17:00

会場: 東京ビッグサイト (東展示棟) 菱光社ブース: 東5ホール 5737

平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。弊社はSEMICON Japan 2021に出展致します。

半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでを カバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。

弊社では製造プロセス・品質保証を支える検査装置などのご案内をしております。

展示会場へお越し頂けました際には、是非、弊社ブースへお立ち寄り頂ければと存じます。

2021年 11月吉日 (株)菱光社

## 蛍光X線測定装置 FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-μ SEMI



非破壊でウエハ上の微細パターン部をEDXRFで 金属膜厚・組成比を自動測定するシステムです。

ユーザー要望に合わせたEFEMを構築する事が可能です。

# マクロ・ミクロ ウェハー外観検査装置



300mmウェハに対応したマクロ・ミクロ検査装置です。 TAIKOウェハ、表裏反転、上位通信(SECS/GEM300) など、要望に合わせてカスタム対応可能です。

マクロ検査の位置をミクロでのレビューに合わせる機能も 搭載可能です。

#### 硬X線光電子分光装置 HAXPES Lab



従来の軟X線光電子分光と比較して、深い検出深度と 多様な軌道選択性を持ち、物質の表面から内部まで 非破壊で化学状態の直接観測を実験室で可能とした 装置です。

(従来の軟X線光電子分光は表層から5nm、HAXPESは50nm)





### 表面清浄度パーティクルモニタ PartSens



製造環境中の表面汚染傾向を瞬時に数値化します。 専用のテープリフトパッドを測定対象表面にあて、専用台に セットします。これにより、ヒト・ウエア・設備・部材・ ツールなどの平坦でない表面の清浄度測定が可能です。





測定スター

SEMICON Japan 2021 申し込み方法

SEMICON Japan 2021は事前登録制となっております。

以下URLもしくはQRコードよりご来場登録をお願い致します。

https://semi-reg.smktg.jp/public/application/add/1446?lang=ja



e招待状QRコ









